

입찰공고

1. 입찰에 부치는 사항

가. 입찰명: 전기화학 주사탐침 현미경 장비 입찰

나. 계약기간: 2026년 10월 15일부터 2027년 2월 28일까지(약5개월)

다. 사업예산: 금99,000,000원(부가세, 설치비 포함)

라. 입찰방법: **제한경쟁입찰, 규격·가격 동시**

(제시한 입찰참가자격을 갖춘 업체 중 규격을 충족하고 **예정가격 이하 최저가**를 제시한 업체 낙찰)

마. 입찰 품목 및 수량: 전기화학 주사탐침 현미경 장비, 1대

* 세부사항은 과업지시서 참고

2. 입찰일정

구분	일시	장소	비고
입찰참가신청서 제출 및 투찰 마감	2026.09.16.(수) 10:00	나라장터	전자입찰
입찰(개찰)	2026.09.18.(금) 11:00	나라장터	전자입찰

※ 가격입찰 서류 접수는 나라장터(<https://www.g2b.go.kr/>) 사이트를 통해 제출하되 규격입찰서 및 규격증빙 서류는 본교 산학협력단 입찰·계약담당자 이메일(munhye@swu.ac.kr)로도 제출하여야 함

3. 입찰참가자격

가. 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 경쟁입찰자격을 갖춘 자

나. 과거 본교와의 계약 수행에 있어서 부정당업체로 지정된 이력이 없는 업체

다. 입찰공고일 전일부터 입찰일(낙찰자의 경우 계약체결일)까지 주된 영업소 소재지가 서울 및 경기도에 있는 업체(필수)

라. 공고일 기준 2년 내 장비 입찰 또는 판매 실적 3천만 원 이상인 업체

마. 제조사 물품공급 확약서(정품공급확약서) 또는 기술지원 확약서 첨부가 가능한 업체

바. 입찰공고일 현재 청산·합병·매각 등 정리절차 중이거나 계획 중인 업체 및 법원에 화의 또는 법정관리를 신청 중인 업체는 입찰에 참가할 수 없음

4. 입찰참가신청서류: 사본인 경우 원본대조필인 요

가. 입찰참가신청서

나. 사업자등록증 사본

다. 법인등기부등본(법인인 경우), 주민등록등본(개인인 경우)

라. 인감증명서, 사용인감계(사용인감 지참)

마. 입찰보증보험증권

바. 국세 및 지방세 완납증명서

사. 실적증명서

아. 견적서(산출내역서)

자. 정품공급확인서 / 기술지원확약서 / 제조사증명서

5. 규격확인서류: 사본인 경우 원본대조필인 要

가. 입찰자는 각 평가항목에 대하여 요구규격 충족 여부를 확인할 수 있는 자료를 제출하여야 한다.

나. 제출 자료: **해당 장비의 제조사, 모델명 및 요구규격에 대응하는 사양을 명확히 표시**

1) 장비 규격서 : 과업지시서 요구규격과 입찰 장비 규격의 일치 여부

2) 제조사 공식 사양서 또는 카탈로그 : 정량적 요구규격 및 기능 확인

3) 장비 매뉴얼 등 기술자료 : 측정모드 및 주요기능 확인

4) 기타 규격 증빙자료 : 평가위원회가 필요하다고 인정하는 자료

6. 입찰보증금과 귀속에 관한 사항

가. 입찰총액의 100분의 5 이상의 금액을 입찰참가신청 마감일시까지 보증보험증권으로 납부하여야 하며, 입찰보증금의 각서 대체는 허용하지 아니한다.

나. 낙찰자가 정당한 이유 없이 낙찰일로부터 10일 이내에 계약을 체결하지 아니할 때에는 당해 입찰보증금은 본교 산학협력단에 귀속된다.

7. 낙찰자 결정 방법

가. 본 입찰은 규격·가격 동시입찰 방식으로 실시하며, 규격입찰서와 가격입찰서를 동시에 제출받는다.

나. 규격입찰서 평가 결과 과업지시서에서 정한 필수규격을 모두 충족하여 규격 적격자료 확정된 입찰자에 한하여 가격입찰서를 개찰한다.

다. 규격 적격자 중 본교 예정가격 이하 최저가를 제시한 입찰자를 낙찰자로 결정한다.

라. 규격입찰서 평가 결과 부적격자로 판정된 입찰자의 가격입찰서는 개찰 대상에서 제외한다.

마. 동일가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 경우 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제47조 및 입찰유의서에서 정한 방법에 따라 낙찰자를 결정한다.

바. 규격평가의 세부기준은 별첨 「규격서 평가기준」 및 「장비 규격서」에 따른다.

8. 입찰의 무효

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령 제39조제4항 및 동법 시행규칙 제44조에 해당하는 입찰은 무효가 된다.

9. 기타 유의사항

가. 입찰자는 본교의 입찰유의서, 기타 입찰에 필요한 모든 사항에 관하여 완전히 숙지하고 입찰에 응하여야 하며 이를 숙지하지 못한 책임은 입찰자에게 있다.

나. 입찰절차 및 계약 업무에 관한 모든 사항은 본교 「계약에 관한 규정」과 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른다.

- 다. 무상보증기간은 본교 산학협력단의 사용자 검수 완료일로부터 적용하며 사용자 검수가 미완료된 상태에서 주요 기자재가 파손 또는 분실될 경우 본교 산학협력단은 책임지지 아니한다.
- 라. 적합한 업체가 없을 경우 선정하지 아니할 수 있으며 필요할 경우 타 업체를 대상으로 추가 입찰 공고를 할 수 있다.
- 마. 입찰 결과에 대하여 일체의 이의를 제기할 수 없다.
- 바. 산출내역서 작성 시 장비의 조립 및 설치비 모두를 포함하여 작성하여야 한다.
- 사. 기타 입찰과 관련된 자세한 사항은 경영지원팀 문혜련 직원(02-970-5806)에게 문의하시기 바랍니다.

2026.09.03.

서울여자대학교 산학협력단장

규격서 평가기준

- 사업명: 전기화학 주사탐침 현미경 장비 입찰
- 입찰방법: 제한경쟁입찰, 규격·가격 동시입찰
- 평가방법: 규격 적격·부적격 평가

1. 평가방법

- 가. 본 평가표는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 규격·가격 동시입찰의 규격입찰서 평가를 위한 기준으로 한다.
- 나. 평가대상 장비가 과업지시서에서 정한 필수 요구규격을 모두 충족하는지 여부를 확인한다.
- 다. 각 평가항목은 다음과 같이 판정한다.
- 1) 적격(○): 요구규격을 충족함
 - 2) 부적격(X): 요구규격을 충족하지 못함
 - 3) 확인불가: 제출자료만으로 충족 여부를 확인할 수 없음
- 라. 필수규격 중 하나라도 부적격 또는 확인불가인 경우에는 규격 부적격으로 판정한다.
- 마. 규격평가 결과 적격자로 확정된 입찰자에 한하여 가격입찰서를 개찰한다.
- 바. 규격평가는 가격과 분리하여 실시한다.

2. 규격 평가기준: 과업지시서의 요구규격을 기준으로 하며, 특정 제조사 또는 특정 모델과의 동일 여부를 평가하지 않는다.

연번	평가항목	요구규격
1	Large Stage Sample Loading	직경 210mm, 대면적 시료를 바로 장착하여 비파괴 상태로 측정 가능
2	Tip Scanning Stage 방식	시료의 크기 및 무게가 측정 결과에 영향을 주지 않는 방식
3	X-Y Scan Range	90 μm x 90 μm typical, 85 μm minimum 이상
	Z Range	10 μm typical in imaging and force curve modes, 9.5 μm minimum 이상
4	Vertical Noise Floor	30pm RMS 이하 (in appropriate environment typical imaging bandwidth(up to 625Hz))
5	Sample Size/Holder	210mm vacuum chuck for samples, 210mm diameter, 15mm thick 이상
6	Motorized Position Stage (X-Y axis)	210mm × 210mm inspectable area; 2 μm repeatability, unidirectional; 3 μm repeatability, bidirectional;
7	Microscope Optics	5-megapixel digital camera; 180 μm to 1465 μm viewing area; Digital zoom and motorized focus 1.6 μm 또는 이상
8	Nanomechanical Property Mapping Fage	1 MPa~70 GPa 영역 측정
9	Dark Lift	시료가 빛에 영향을 받아 정밀한 측정이 어려운 경우 시료에 빛을 사용하지 않고 정밀한 전기적 특성 측정
10	Measurement Mode	Contact mode 지원 Lateral Force Microscopy (LFM) 지원 Force Spectroscopy지원 Force Volume Mapping (with linear ramps)지원 Tapping mode with Phase Imaging 지원 Magnetic Force Microscopy (MFM) 지원 Electric Force Microscopy (EFM) 지원 Kelvin Probe Force Microscopy (KPFM) in single pass and dual pass 지원 Piezoresponse Force Microscopy (PFM) 지원 Liftmode 지원